



KUULUTUSJULKAISU [B] (11) UTLÄGGNINGSSKRIFT

73615

(45) Patambti by Janutty Potent nativalat 39 11 1987

(51) Kv.lk.4/Int.Cl.4 B 25 J 13/08, B 24 C 3/08

SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus Patent- och registerstyrelsen

(21) Patenttihakemus – Patentensökning	830646
(22) Hakemispäivä – Ansökningsdag	28.02.83
(23) Alkupäivä – Giltighetsdag	28.02.83
(41) Tullut julkiseksi – Blivit offentlig	29.08.84
(44) Nähtäväksipanon ja kuul julkaisun pvm. –	31.07.87

(86) Kv. hakemus – Int. ansökan

(32) (33) (31) Pyydetty etuoikeus - Begärd prioritet

Ansökan utlagd och utl.skriften publicerad

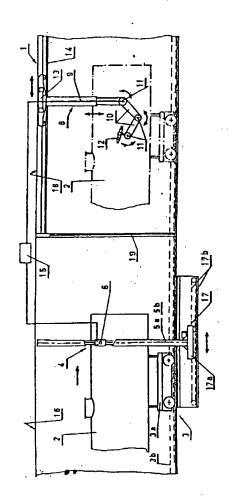
- (71) Oy Tampella Ab, PL 256, 33101 Tampere, Suomi-Finland(FI)
- (72) Leo Häkkinen, Tampere, Aulis Holmala, Tampere, Heikki Liuhanen, Vuorentausta, Suomi-Finland(F1)
- (74) Tampereen Patenttitoimisto
- (54) Menetelmä ja laitteisto kappaleen pinnan käsittelemiseksi -Förfarande och anordning för ytbehandling av ett arbetsstycke

(57) Tiivistelmä

Keksinnön kohteena on menetelmä ja laitteisto kappaleen (2) pinnan käsittelemiseksi käsittelylaitteistolla (8). Kappale syötetään ensin mittauslaitteistoon (4), jolla mitataan kappaleen pinnen muoto ja asema mittauslaitteen suhteen. Mittatiedot siirretään tietojenkäsittely- ja ohjauslaitteistoon, joka annetun ohjelman mukaan määrittelee käsittelyvälineen (12) liikeradan. Mittauksen jälkeen kappale siirretään käsittelylaitteistoon (8) siten, että sen asema käsittelylaitteiston suhteen on määrätty. Pinnan käsittelemiseksi tietojenkäsittely- ja ohjauslaitteisto ohjaa käsittelyvälinettä (12) määriteltyä liikerataa pitkin.

(57) Sammandrag

Uppfinningen avser förfarandet och anläggningen för ytbehandling av arbetsstycket (2) med behandlingsanläggningen (8). Arbetsstycket mätas först till mätningsanläggningen (4), med vilken ytbildningen och läget av arbetsstycket mätas i förhållandet av mätningsanordningen. Mätningsuppgifterna föras till databehandlings- och styrningsanläggningen, vilken enligt det givna programet definierar rörelsebanan av behandlingsverktyget (12). Efter mätningen föras arbetsstycket till behandlingsanläggningen (8) så, att dess läge i förhållandet av behandlingsanläggningen är bestämt. För behandlingen av ytan styr databehandlings- och styrningsanläggning behandlingsverktyget (12) längs det givna rörelsebanan.



Menetelmä ja laitteisto kappaleen pinnan käsittelemiseksi - Förfarande och anordning för ytbehandling av ett arbetsstycke

Keksinnön kohteena on menetelmä kappaleen pinnan käsittelemiseksi käsittelylaitteistossa käsittelyvälineellä, jolloin pintaa käsiteltäessä käsittelyvälinettä siirretään pitkin liikerataa, joka on ennen käsittelyä määrätty käsiteltävän pinnan muodon perusteella.

On ennestään tunnettua käyttää tähän tarkoitukseen robottia. Tällöin jokaisen erilaisen kappaleen käsittelyä varten käsittelyvälineen rata joudutaan erikseen opettamaan robotille. Tämä voi tapahtua määrittelemällä rata silmämääräisesti tai syöttämällä robotin ohjauslaitteeseen radan matemaattinen kaava. Rata voidaan opettaa robotille myös ohjaamalla sitä siitä kiinnipitäen halutulla tavalla pitkin pintaa, jolloin rata tallentuu robotin muistiin jatkotyöskentelyä varten.

Edelleen on ennestään tunnettua, että esimerkiksi hiekkapuhallusta suoritetaan myös mekaanisilla laitteilla, joissa on käytetty numeerista ohjausta. Tällöin hiekkapuhallussuutin seuraa yleensä käsin ohjauspaneelilta määriteltyä rataa. Rata voidaan määritellä silmämääräisesti tai matemaattisella kaavalla.

Näiden tunnettujen menetelmien haittapuolet tulevat ilmi ennen kaikkea pienehköjen sarjojen ja yksittäiskappaleiden tuotannossa, jolloin radan määrittely riittävän nopeasti ja tarkasti tuottaa hankaluuksia. Myöskään radan määrittelyvaiheen ja varsinaisen käsittelyvaiheen liittyminen toisiinsa ei ole joustavaa.

25 Tämän keksinnön tarkoituksena on poistaa edellä mainitut haitat. Tämä tarkoitus saavutetaan patenttivaatimusten tunnusosien mukaisilla ratkaisuilla.

Keksintö perustuu siihen ajatukseen, että käsiteltävä kappale kulkee siirtolaitteella ensin mittauslaitteiston läpi, jossa

5

10

kappaleen pinnan muoto ja asema mitataan mittauslaitteiston suhteen ja siten välillisesti siirtolaitteen suhteen. Mittauslaitteiston antamat mittatiedot siirtyvät mikroprosessoriin tai vastaavaan tietojenkäsittely- tai ohjauslaitteeseen, joka sitten tallentaa ja käsittelee nämä tiedot ennalta laaditun ohjelman mukaan liikeradan määrittelemiseksi pinnan käsittelyvälineelle niiden perusteella. Mittaamisen jälkeen kappale siirretään käsittelylaitteistoon, joka sijaitsee edullisesti välittömästi mittauslaitteiston jälkeen. Kun kappaleen asema siirtolaitteessa ei siirron aikana muutu, on se siten yksikäsitteisesti määrätty vaikkakin taas välillisesti, käsittelylaitteiston suhteen. Toisaalta voidaan sanoa, että käsittelylaitteiston asema mittauslaitteiston suhteen on siirtolaitteiston kautta määrätty.

Käsittelylaitteistossa, jonka sijainti siis mittauslaitteiston 15 tai siirtolaitteiston suhteen on määrätty, kappale pintakäsitellään. Sekä mittaus että käsittely tapahtuvat automaattisesti. Tietojenkäsittely- ja ohjauslaite ohjaa käsittelyvälinettä, kuten suutinta tai vastaavaa pitkin rataa, joka on ennalta laaditun ohjelman mukaisesti määritelty käsiteltävän kappaleen mi-20 tatun pinnan muodon perusteella.

Keksinnön kohteena on myös laitteisto mainitun menetelmän to-

Keksintöä selitetään lähemmin seuraavassa viitaten oheiseen 25 piirustukseen, jossa

kuva l esittää laitteistoa sivukuvana ja

kuva 2 esittää mittakehän kahtà eri suoritusmuotoa.

Kuvassa 1 on laitteisto kokonaisuudessaan merkitty viitenumerolla 1. Käsiteltävä kappale on merkitty viitenumerolla 2 ja sen siirtämiseen tarkoitettu laitteisto viitenumerolla 3. Ku-;0 viossa on esitetty sekä siirtovaunu 3a, että rata 3b, jota

5

pitkin siirtovaunu liikkuu. Vaunu voi liikkua jatkuvasti tai pysähtyä määrävälimatkoin. Siirtolaitteistoon 3 kuuluu laitteet vaunun liikkeen käynnistämistä ja pysäyttämistä varten (ei esitetty).

5 Viitenumerolla 4 on merkitty mittauslaitteisto ja viitenumerolla 8 kappaleen pinnan käsittelylaitteisto. Edellinen sijaitsee mittaustilassa 16 ja jälkimmäinen käsittelytilassa 18. Näiden tilojen välissä on ovi 19. Mittauslaitteistoon 4 kuuluu mittakehä, viitenumerot 5a ja 5b. Mittakehälle on sijoitettu yksi tai useampia mittalaitteita 6. Ne voivat sijaita mittakehällä 10 joko kiinteästi tai liikkuvasti. Mittalaitteiden siirtämistä pitkin mittakehää kappaleen ympäri voi mittakehässä olla rata 7a, 7b. Mittauslaitteisto 4 on asennettu siirtolaitteelle 17, johon kuuluu rata 17b ja sen varassa liikkuva vaunu 17a. Tätä 15 siirtolaitetta ohjataan mittauslaitteiston avulla, jolloin vaunu 17a voi liikkua jatkuvasti tai se voidaan pysäyttää määrävälimatkoin. Tätä varten siirtolaitteessa 17 on käynnistys- ja pysäytyslaitteet (ei esitetty).

Käsittelylaitteistoon 8 kuuluu puomi 9, joka edullisesti on esimerkiksi teleskooppipuomi, kääntövarsia 10 tarpeen mukaan, niiden välisiä niveliä 11 sekä käsittelyväline, joka voi olla suutin tai sen tapainen ja jota on merkitty viitenumerolla 12. Suutin on liitetty kääntyvällä nivelellä 11 varren 10 päähän. Käsittelylaitteisto 8 on asennettu vaunuun 13, joka on siirrettävissä pitkin kiskoa 14.

Laitteistoon kuuluu mikroprosessori tai vastaava laite 15, jossa on tietojen vastaanotto-, taltiointi- ja käsittelylaitteet sekä ohjauslaitteet suuttimen ohjaamiseksi pinnan muodon mukaan.

30 Laitteisto toimii seuraavasti:

Kappaleen ollessa mittaustilassa sen pinnan muoto voidaan mitata esimerkiksi seuraavilla eri tavoilla:

Mittauslaitteisto pysyy paikallaan ja kappale liikkuu mittakehän läpi. Tällöin saadaan kappaleen eräänlaisen sivuviivan profiili. Tätä mittaustapaa käytettäessä on edullista, että mittakehän 5a, 5b kehällä on ennalta määrätyin välein useita mittalaitteita, jotka toimivat samanaikaisesti. Saatujen profiilitietojen perusteella voidaan kappaleen pinnan muoto ja asema määritellä riittävällä tarkkuudella matemaattisesti. Tämä tehdään tietojenkäsittelylaitteen avulla.

Kappaleen pinnan muotoa voidaan mitata myöskin yhdessä tai useammassa tasossa, jotka ovat poikittain kappaleen liikeradan suuntaa vastaan ja välimatkan päässä toisistaan. Tätä tapaa käytettäessä voidaan menetellä siten, että mittauslaitteisto on paikoillaan ja kappale liikkuu sen läpi pysähtyen määrävälimatkoin. Kussakin kohdassa mittalaite 6 liikkuu pitkin rataa 7a, 7b suorittaen mittauksen. Voidaan myös menetellä siten, että kappale on paikoillaan ja mittalaitetta liikutetaan mittakehässä 5a, 5b olevaa rataa 7a, 7b pitkin poikittain kappaleen liikeradan suuntaan nähden. Kun mittaus yhdessä tasossa on suoritettu, siirretään mittauslaitteisto välimatkan päässä olevaan kohtaan, jossa mittaus suoritetaan vastaavasti. Voidaan myöskin menetellä siten, että kussakin tasossa suoritettavan mittauksen aikana mittauslaitteisto liikkuu kappaleen liikesuunnassa samalla nopeudella kuin mitattava kappale. Näissä tapauksissa saadaan kappaleen pinnasta poikittaisprofiilitiedot, joiden perusteella kappaleen muoto ja asema voidaan matemaattisesti mää-

Vielä voidaan mittaus suorittaa siten, että mittauksen aikana kappaletta liikutetaan tietyllä nopeudella ja mittaus suoritetaan tasossa, joka on tietyssä kulmassa kappaleen liikesuuntaa vasten. Edullisesti tämä tapahtuu mittakehän 5a, 5b tason ollessa asetettu kohtisuoraan kappaleen liikesuuntaa vastaan, jolloin mittalaitteen liikkuessa saadaan kappaleesta vinottain sen liikesuuntaan nähden olevat poikittaisprofiilit, joiden perusteella kappaleen pinnan muoto ja asema voidaan määritellä.

30

25

1

1

T0\01 .03 bE

10:22 FAX 358 9 739378

5

10

Kappaleen pinnan muoto voidaan myös määritellä sopivin välein olevien pisteiden perusteella, jolloin kappaleen pinnasta mitataan kunkin pisteen koordinaatit ja pinnan muoto ja asema lasketaan niiden perusteella.

- Mittauslaitteiston antamat tiedot syötetään mikroprosessoriin tai vastaavaan laitteeseen, jossa on edellä kuvatut laitteet ja toiminnat. Kun kappale mittaustilasta siirtyy käsittelytilaan, alkaa käsittelylaitteisto 8 toimia ja mikroprosessorin tai vastaavan ohjausjärjestelmä ohjaa käsittelylaitteiston 8 suutinta 12 pitkin kappaleen mitatun pinnan muodon perusteella määrättyä rataa. Suuttimen tms. sijaan voi käsittelyvälineenä olla jokin muu väline, kuten harja tai pintaa karhentava tai työstävä väline tai mikä muu pintaa koskeva tai koskettamaton siihen jollain tavoin vaikuttava väline.
- Mittalaitteen toiminta voi perustua videomenetelmään, laseriin, ultraääneen, tutkaan tai johonkin muuhun vastaavaan, kappaletta koskettamattomaan mittamenetelmään tai niiden yhdistelmään.
 - Mittakehä voi olla kuvissa 2a ja 2b esitetyn tapainen kappaletta ja siirtovälinettä täysin ympäröivä. Se voi kuitenkin olla myös vain kappaleen sivuille ja päälle ulottuva kaari, osittain avoin kehä tai minkä muun muotoinen tahansa.

Käytännössä pitkiä ja suuria kappaleita käsiteltäessä on mahdollista, että kappale saapuu käsittelyvaiheeseen samanaikaisesti kun osa kappaleesta on vielä mittauksen alaisena. Tällä ei kuitenkaan ole mitään olennaista merkitystä kappaleen käsittelemisen kannalta, koska tieto kappaleen alkuosan muodosta on jo prosessorin käytössä ja se voi siten samanaikaisesti ohjata käsittelylaitetta ja ottaa vastaan uutta tietoa kappaleen muun osan pinnasta. Tällöin käsittelyvälineen liikerata käsiteltävänä olevalle kohdalle on määritelty jo ennen sen tuloa käsiteltävätäväksi.

25

Koska laitteen mittauspaikka ja käsittelypaikka ovat toisistaan 73615 erilliset, on myös mahdollista, että ensimmäisen kappaleen ollessa käsittelyn alaisena on toinen kappale samanaikaisesti pinnan määrittelyn kohteena.

- Kappaleen pinnasta saatu tieto voidaan myöskin varastoida pro-5 sessorissa tavallisesti olevaan muistiin seuraavan samanlaisen kappaleen käsittelemistä varten. Tällöin tuotesarjojen käsittelyssä voidaan tietynlaisella kappaleen kiinnityksellä siirtyä suoraan mittausvaiheen ohi kappaleen käsittelyyn.
- 10 Laitteisto on erityisen edullinen silloin, kun kyseessä on pienien tuotesarjojen tai yksittäistuotteiden käsittely. Käsittelylaitteistoon voidaan syöttää peräkkäin aivan erilaisia tuotteita ilman, että käsittelynopeus hidastuisi tai että sen vuok-1! si tarvittaisiin erillisiä ohjelmiston vaihtoja tai muuta ai-15 kaaviepää työtä.
- Menetelmää ja laitteistoa voi tietysti soveltaa siten, että eri vaiheet suoritetaan erikseen ohjaamalla, jolloin laitteisto 21 tarvitsee jatkuvasti hoitajan. Edullisimmassa toteutusmuodossaan laitteisto toimii täysin automaattisesti, jolloin eri vaiheiden suoritusta ohjataan mikroprosessorin, ajastimen tms. 50 avulla. Tällöin tarvitsee vain asettaa kappale siirtolaitteeseen ja tarvittaessa käynnistää laitteisto. 3.5

VMEK BYTENTS

3(

3

5

10

15

20

- Menetelmä kappaleen pinnan käsittelemiseksi käsittelylait-1. teistossa käsittelyvälineellä, jolloin pintaa käsiteltäessä käsittelyvälinettä siirretään pitkin liikerataa, joka on ennen käsittelyä määrätty käsiteltävän pinnan muodon perusteella, t u n n e t t u siitä, että kappale (2) syötetään ensin mittauslaitteistoon (4), jolla määritetään sekä kappaleen pinnan muoto että kappaleen asema mittauskoordinaatiston suhteen, että näin saadut tiedot siirretään tietojenkäsittely- ja ohjauslaitteistoon, joka käsittelee ne ennalta laaditun ohjelman mukaan liikeradan määrittelemiseksi käsittelyvälineelle (12) niiden perusteella, että kappale (2) mittaamisen jälkeen siirretään käsittelylaitteistoon (8) siten, että kappaleen (2) asema käsittelylaitteiston suhteen on em. mittausten perusteella määrätty ja että pinnan käsittelemiseksi tietojenkäsittely- ja ohjauslaitteella ohjataan käsittelyvälinettä pitkin em. mittausten perusteella määriteltyä liikerataa.
- 2. Patenttivaatimuksen l mukainen menetelmä, t u n n e t t u siitä, että kappaleen pinnan muotoa mitataan mittauslaitteiston pysyessä paikallaan ja kappaleen liikkuessa mittauslaitteiston läpi.
- 3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kappaleen pinnan muoto mitataan useassa tasossa, jotka ovat poikittain kappaleen liikeradan suuntaa vastaan ja välimatkan päässä toisistaan.
- 4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, t u n n e t t u siitä, että mittauslaitteisto on paikallaan, ja kappale liikkuu sen läpi pysähtyen määrävälimatkoin.
 - 5. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, t u n n e t t u siitä, että kappale pidetään mittauksen aikana paikoillaan ja kun mittaus yhdessä tasossa on suoritettu, siirretään mittauslaitteisto välimatkan päässä olevaan kohtaan, jossa mittaus suoritetaan vastaavasti.

- 6. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kussakin tasossa suoritettavan mittauksen aikana mittauslaitteistoa liikutetaan kappaleen liikesuunnassa kappaleen nopeudella.
- 7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, t u n n e t t u siitä, että mittauslaitteistossa mittaus suoritetaan kappaletta koskettamattomalla mittausmenetelmällä, kuten videolla, laserilla, ultraäänellä, tutkalla tai vastaavalla.
- 8. Laitteisto patenttivaatimuksen 1 mukaisen menetelmän toteuttamiseksi, t u n n e t t u siitä, että siihen kuuluu mittauslaitteisto (4), jossa on vähintään yksi mittalaite (6), tietojenkäsittely- ja ohjauslaitteisto (15), jossa on tietojen vastaanotto- ja käsittelylaitteet sekä ohjauslaitteet ja käsittelylaitteisto (8), jossa on käsittelyväline (12), sekä siirtolaitteisto (3), johon kuuluu siirtovaunu kappaleen siirtämiseksi mittauslaitteiston (4) ja käsittelylaitteiston (8) kautta.
 - 9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mittauslaitteistossa (4) on mittakehä (5a, 5b), joka on sijoitettu poikittain kappaleen liikesuuntaan nähden ja johon on sijoitettu vähintään yksi mittalaite (6) sekä mittauslaitteiston siirtolaite (17), johon kuuluu rata (17b) ja vaunu (17a).
 - 10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen laitteisto, t u n n e t t u siitä, että mittakehässä on rata (7a,7b), johon kukin mittalaitee (6) on liitetty siirtokoneiston välityksellä mittalaitteen (6) siirtämiseksi rataa pitkin kappaleen liikesuuntaan nähden poikittaisessa suunnassa.
- 11. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laitteisto, t u n n e t t u siitä, että kappaleen siirtolaitteistossa (3) on laitteet siirtovaunun (3a) liikkeen käynnistämiseksi ja pysäyttämiseksi määrävälimatkoin.

1

31

15

}(

12. Patenttivaatimuksen 9 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että että siirtolaitteessa (17) on laitteet vaunun (17a) liikkeen käynnistämiseksi ja pysäyttämiseksi määrävälimatkoin.

Patentkrav:

73615

- Förfarande för ytbehandling av ett stycke i en behand-1. lingsanläggning medels ett behandlingsverktyg, varvid under ytbehandlingen behandlingsverktyget förs längs en rörelsebana, vilken före behandlingen är bestämd på grund av ytbildningen av 5 ytan, som skall behandlas, kännetecknat att stycket (2) inmatas först till en mätningsanläggning (4), med hjälp av vilken både ytbildningen av stycket och läget av stycket i förhållande till mätningskoordinater definieras, att den så erhållna informationen överförs till en databehandlings-1 10 och styrningsanläggning, vilken behandlar den enligt ett förutbestämt program för definiering av behandlingsverktygets (12) rörelsebana på grund av denna, att stycket (2) efter mätningen förs till behandlingsanläggningen (8) så, att styckets (2) läge i förhållande till behandlingsanläggningen är bestämt på grund կ 15 av nämnda mätningar och att för behandling av ytan behandlingsverktyget styrs med hjälp av databehandlings- och styrningsanläggningen längs rörelsebanan, som definierats på grund av nämnda mätningar.
- Förfarande enligt patentkravet 1, k ä n n e t e c k n a t 220 därav, att ytbildningen av stycket mäts medan mätningsanläggningen kvarstår på sin plats och stycket rör sig genom mätningsanläggningen.
 - Förfarande enligt patentkravet 1, k ännetecknat 3. därav, att ytbildningen av stycket mäts i flera plan, vilka ligger tvärsgående mot riktningen av styckets rörelsebana och befinner sig på ett avstånd från varandra.
 - Förfarande enligt patentkravet 3, k ännetecknat därav, att mätningsanläggningen är stationär och stycket rör sig genom denna stannande på bestämda avstånd.

225

3

1

L:

- 5. Förfarande enligt patentkravet 3, k ä n n e t e c k n a t därav, att stycket hålls under mätningen på sin plats och sedan mätningen i ett plan är utförd, förs mätningsanläggningen till ett på ett avstånd därifrån liggande ställe var mätningen utförs på motsvarande sätt.
- 6. Förfarande enligt patentkravet 3, k ä n n e t e c k n a t därav, att under en mätning i vart plan rörs mätningsanläggningen i styckets rörelseriktning med styckets hastighet.
- 7. Förfarande enligt patentkravet l, k ä n n e t e c k n a t därav, att mätningen utförs i mätningsanläggningen med hjälp av ett kontaktfritt mätningsförfarande, såsom med en video, med laser, med ultraljud, med radar eller med dylikt.
 - 8. Anläggning för utförande av förfarandet enligt patentkravet 1, k ä n n e t e c k n a d därav, att den omfattar
 en mätningsanläggning (4), vilken innehåller minst en mätningsanordning (6), en databehandlings- och styrningsanläggning
 (15), vilken innehåller medel för mottagandet och behandlingen
 av information samt styrningsanordningar och en behandlingsanläggning (8), vilken omfattar ett behandlingsverktyg (12),
 samt en överföringsanläggning (3), vilken omfattar en överföringsvagn för överföring av stycket genom mätningsanläggningen (4) och behandlingsanläggningen (8).
 - 9. Anläggning enligt patentkravet 8, k ä n n e t e c k n a d därav, att mätningsanläggningen (4) omfattar en mätningsram (5a, 5b), vilken är placerad tvärsgående mot styckets rörelseriktning och i vilken är placerad minst en mätanordning (6) samt mätningsanläggningens överföringsanordning (17), vilken omfattar en bana (17b) och en vagn (17a).
- 10. Anläggning enligt patentkravet 9, k ä n n e t e c k n a d därav, att mätningsramen omfattar en bana (7a, 7a), på vilken var mätanordning (6) är ansluten medels en flyttmekanism för flyttandet av mätanordningen (6) längs banan i en mot styckets rörelseriktning tvärsgående riktning.

5

15

20

- 11. Anläggning enligt patentkravet 8, k ä n n e t e c k n a d därav, att styckets överföringsanläggning (3) omfattar medel för startande och stannande för överföringsvagnens (3a) rörelse på bestämda avstånd.
- 5 12. Anläggning enligt patentkravet 9, k ä n n e t e c k n a d därav, att överföringsanordningen omfattar medel för startande och stannande av vagnens (17a) rörelse på bestämda avstånd.

Viitejulkaisuja-Anförda publikationer

Tekniikka, 3, 1981, "Näkevän robotin kehittämisessä vielä työmaata", p. 28-30.

3

L!

Ц

) [

